平成 28 年 4 月 19 日

平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 1
分科会委員各位

一般社団法人 日本粉体工業技術協会
平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 1
委員長　東谷　公

第 1 回（通算第 4 回）平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 1
分科会開催のご案内
（ゼータ電位の測定法 - 光学的方法）

拝啓　時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

　さて、分科会を下記にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

日　時　：　平成 28 年 5 月 20 日（金）13:00～17:00
（分科会後、懇親会を開催します。会場は後ほどお知らせいたします。）

場　所　：　協会本部事務所会議室
京都市下京区烏丸通り六条上ル北町 181 番地　第 5 キョートビル 8 階
Tel: 075-354-3581
最寄駅：地下鉄烏丸線 「五条」 5 番出口より南へ徒歩 1 分

連絡先：（一社）日本粉体工業技術協会　大久保　email: okubo@appie.or.jp

議　題　：　原案審議

以上